## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-331532 (P2002-331532A)

(43)公開日 平成14年11月19日(2002.11.19)

(51) Int.Cl. <sup>†</sup>		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
B 2 9 C	39/02		B 2 9 C	39/02	4F204
	39/24			39/24	
G 0 2 B	3/00		G 0 2 B	3/00	Z
# B29L	11:00		B 2 9 L	11: 00	•

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号 特願2001-141431(P2001-141431)

(22) 出願日 平成13年5月11日(2001.5.11)

(71) 出窗人 000004226

日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72)発明者 石井 雄三

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(74)代理人 100075753

弁理士 和泉 良彦 (外1名)

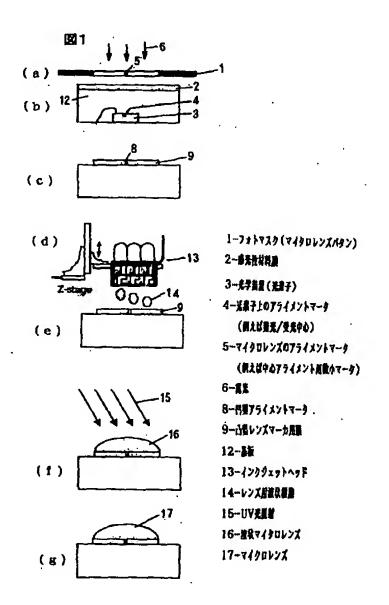
Fターム(参考) 4F204 AA44 AH75 EA03 EB01 EK18

# (54) 【発明の名称】 マイクロレンズ形成方法

## (57)【要約】

【課題】光学装置(光素子、光部品等)とマイクロレンズとの光軸合わせを、簡易に低コストでアライメントできるマイクロレンズ形成方法を提供する。

【解決手段】マイクロレンズを形成するマイクロレンズパタンとアライメントマークパタンとを有するフォトマスク(1)を用い、光素子(3)を有する光学装置のアライメントマークを光素子の発光または受光中心として、マイクロレンズのアライメントマーク(5)と光素子のアライメントマーク(4)とを位置合わせすることにより、マイクロレンズと光学装置の光軸合わせをして、基板(12)上に、中心にアライメントマーク(8)を有するマイクロレンズパタンを転写したレンズマーカ用膜(9)を形成し、レンズマーカ用膜上に、レンズ用液状樹脂を射出して液状のマイクロレンズを形成し、UV光を照射して硬化させてマイクロレンズとする。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】光信号光が透過する基板を介して光信号が 光素子に入出力する光学装置の上記基板表面にマイクロ レンズを形成する方法であって、

上記マイクロレンズを形成する部分を規定するマイクロ レンズパタンと、該パタンの内部に形成されたアライメ ントマークパタンとを有するフォトマスクを用い、

他方、光学装置のアライメントマークを、上記光素子の 発光または受光中心とするか、もしくは光素子上に別に 形成したアライメントマークを設け、上記フォトマスク 10 法。 のアライメントマークと、上記光学装置のアライメント マークとを位置合わせすることにより、上記フォトマス クと上記光学装置の位置を合わせ、上記マイクロレンズ を形成する基板上に、上記マイクロレンズ材料と屈折率 の等しい感光性材料膜を形成する工程と、

上記感光性材料膜上に、上記フォトマスクを用い露光、 および現像することにより、中心にアライメントマーク を有するマイクロレンズパタンを転写したレンズマーカー 用膜を形成する工程と、

ンズ用液状樹脂を射出して、液状のマイクロレンズを形 成する工程と、

UV光を照射して、上記液状のマイクロレンズを硬化さ せてマイクロレンズを形成する工程とを少なくとも含む ことを特徴とするマイクロレンズ形成方法。

【請求項2】光信号光が透過する基板を介して光信号が 光素子に入出力する光学装置の上記基板表面にマイクロ レンズを形成する方法であって、

上記マイクロレンズを形成する部分を規定するマイクロ レンズパタンと、該パタンの内部に形成されたアライメ ントマークパタンとを有するフォトマスクを用い、

他方、光学装置のアライメントマークを、上記光素子の 発光または受光中心とするか、もしくは光素子上に別に 形成したアライメントマークを設け、上記フォトマスク のアライメントマークと、上記光学装置のアライメント マークとを位置合わせすることにより、上記フォトマス クと上記光学装置の位置を合わせ、上記マイクロレンズ を形成する基板上に、感光性材料膜を形成する工程と、 上記基板上に形成した感光性材料膜に、上記フォトマス クを用いて、上記マイクロレンズを形成する部分を規定 するマイクロレンズパタンと、該パタンの内部に形成し たアライメントマークパタンとを転写する工程と、

上記感光性材料膜を過現像して、該感光性材料膜に転写 された上記アライメントマークを消去し、上記マイクロ レンズを形成する部分を残したレンズマーカ用膜を形成 する工程と、

上記マイクロレンズを形成する部分に、レンズ用液状樹 脂を射出して、液状のマイクロレンズを形成する工程 と、

せてマイクロレンズを形成する工程とを少なくとも含む ことを特徴とするマイクロレンズ形成方法。

【請求項3】請求項2において、上記感光性材料膜を過 現像して、アライメントマークを消去し、マイクロレン ズを形成する部分を残したレンズマーカ用膜は、上記基 板表面上の上記マイクロレンズを形成する部分に近接し て、該マイクロレンズを形成する部分の外側の領域に形 成され、かつ上記光信号光の波長に対して吸収性を有す る材料よりなることを特徴とするマイクロレンズ形成方

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光学装置のマイクロ レンズ製造技術に関する。

[0002]

【従来の技術】図6は、特開2000-180605号 公報(特願平10-358956号)に記載された従来 のマイクロレンズ製造方法の一例を示す。この従来の方 法は、液状の紫外線(UV光)硬化樹脂を、インクジェ 上記レンズマーカ用膜のマイクロレンズパタン上に、レ 20 ットヘッド13により、レンズ用液状樹脂14として基 板12上に射出し、表面張力により球状化させたところ を、UV光照射15により硬化させて、マイクロレンズ 21を形成するものである。ピエゾ駆動素子などを用い て、液状の紫外線(UV光)硬化樹脂の射出量を正確に 制御することができ、再現性と制御性の高いマイクロレ ンズアレイを作製することが可能である。また、任意の 基板12上にダイレクトにレンズを形成することができ るため、半導体レーザや、受光素子、光導波路などの光 部品にマイクロレンズを一体化することが容易である。 30 滴下された液状樹脂が基板となす角、すなわち接触角 は、液状樹脂と基板の表面張力の関係に大きく依存す る。液状樹脂と基板の表面張力の関係は、樹脂の粘度、 樹脂と基板のそれぞれの温度、基板の表面形状などによ って決定されるが、それらの条件が同一であれば接触角 は一意的に決定されるため、マイクロレンズの製造方法 として適用することは可能である。マイクロレンズのレ ンズ特性を表わすパラメータとしては、焦点距離、F 数、レンズ直径(開口径)などが挙げられる。これらの レンズパラメータにおいて、F数は、樹脂の接触角と樹 脂の屈折率とから容易に導くことができる。すなわち、 所定の接触角を形成する樹脂(屈折率は既知)と基板の 組み合わせを用意すれば、所望のF数をもつマイクロレ ンズを作製することができる。また、レンズ直径に関し ては、接触角が射出量に因らず一定であることから、射 出量のみで制御することができる。

【0003】上記従来技術においては、さまざまなレン ズ特性を持つマイクロレンズを簡便に作製することが可 能である。しかしながら、この従来技術はマイクロレン ズを一つずつ作製する方式であり、インクジェットへッ UV光を照射して、上記液状のマイクロレンズを硬化さ 50 ドをマルチノズル化することにより、マイクロレンズア 10

レイを一括して作製することも可能であるが、ターゲッ ト位置と射出ヘッドのアライメント精度は、装置のステ ージ駆動精度および観察系の分解能などに大きく依存す る。つまり、マイクロレンズの形成位置確度を高めるた めには、装置の高精度化をはかる必要がある。装置の高 精度化は、装置の高価格化を意味しており、マイクロレ ンズの製造コストを増加させることになる。 したがっ て、マイクロレンズを低コストで製造するためには、マ イクロレンズの形成位置確度が装置精度に影響されない 製造方法とすることが必要となる。

【0004】図7に、上記マイクロレンズの形成位置確 度が装置精度に影響されない製造方法として提案された マイクロレンズの製造方法の一例を示す〔例えば、特開 昭62-83337号公報(特願昭60-220375 号)]。これは、基板12上に設けた感光性樹脂23を フォトマスク22を用い、露光6、現像してパターニン グにより、基板12上のマイクロレンズを形成すべき部 分に、感光性樹脂23よりなる円盤状の透明樹脂(以 下、凸型レンズマーカ用膜と呼ぶ) 24を形成する方法 である。この凸型レンズマーカである円盤状の透明樹脂 24は、マイクロレンズパタンを有する上記フォトマス ク22を用いたフォトリソグラフィー技術によって作製 されるため、凸型レンズマーカ用膜24の形状、配列ピ ッチの正確性、および再現性は共に高い。

【0005】このような凸型レンズマーカ用膜24がタ ーゲット基板上に形成されている場合には、液状UV光 硬化樹脂25の液滴の射出位置は、上記凸型レンズマー カ用膜24上であればよいので、位置精度は大幅に緩和 される。凸型レンズマーカ用膜24上に射出された液滴 は、凸型レンズマーカ用膜24上を濡れ広がるが、その 周縁部で広がりは止まり、おのずと球形状を形成する。 凸型レンズマーカ用膜24が円形であるために、レンズ 中心はレンズマーカの中心と正確に一致し、さらには、 マイクロレンズ26の直径は凸型レンズマーカ用膜24 の径によって正確に保持される。

【0006】ここで、フォトマスク22のアライメント は、通常、マスクに形成しておいたアライメントマーク を用いて行われる。このアライメントマークは、マスク のマイクロレンズパタン以外の部分に形成されるが、こ てアライメントされる。ターゲット面に設けられるアラ イメントマークパタンとしては、配線層に形成された微 細パターンであることが多いが、光素子などのチップ部 品や光導波路などの光部品(まとめて光部品と呼ぶ)上 にアライメントマークパタンが作製されることもある。

【0007】光部品が搭載された配線層上にアライメン トマークが形成されている場合には、光部品の搭載精度 を髙めなければ、光部品とマイクロレンズとの光軸はず れることになる。したがって、光軸を合わせるために は、髙精度の光部品の実装技術が必要となり、実装コス 50 光性材料膜上に、上記フォトマスクを用い露光、および

トの増加を招いてしまうことになる。また、光部品にア ライメントマークを形成する場合には、フォトマスク2 2側のアライメントマークと一致させるためには、光部 品のサイズがマイクロレンズのサイズよりも十分大きく なければならない。 アライメントマークをマイクロレン ズ内に設けることもできるが、光透過部分にマークパタ ーンを形成することは、透過光に対して反射・散乱・減 衰などの影響をもたらすために、好ましくない。

# [0008]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来のマイク ロレンズの製造方法において、紫外線硬化樹脂を滴下す る位置確度は装置精度に依存するため、高精度なマイク ロレンズの形成を行うためには、装置の高精度化を図ら なければならず、装置の高コスト化、ひいてはマイクロ レンズの製造コストの増加を招いていた。また、液状樹 脂の滴下位置の精度を緩和するために、あらかじめター ゲット基板上に円盤状のレンズマーカを形成しておく手 法が提案されているが、レンズマーカと光部品(光学装 置) とのアライメントマークの形成について幾つかの課 20 題があった。例えば、正確に光部品を搭載するための高 価な搭載装置が必要であったり、光部品の表面にアライ メントマークを形成しておかねばならないことであった り、アライメントマークを形成するためには光部品がマ イクロレンズよりも大きいことが必要であったり、アラ イメントマークをマイクロレンズ内に設けると光透過特 性に影響を及ぼしレンズ効果が劣化するなどの問題があ った。

【0009】本発明の目的は、上記従来技術の問題を解 決して、光学装置(光素子、光部品等)とマイクロレン 30 ズとの光軸合わせを、簡易に低コストでアライメントす ることができるマイクロレンズ形成方法を提供すること にある。

# [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は特許請求の範囲に記載のような構成とする ものである。すなわち、光信号光が透過する基板を介し て光信号が光素子に入出力する光学装置(光素子、光部 品等) の上記基板表面にマイクロレンズを形成する方法 であって、上記マイクロレンズを形成する部分を規定す れをターゲット面に設けられたアライメントマークとし 40 るマイクロレンズパタンと、該パタンの内部に形成され たアライメントマークパタンとを有するフォトマスクを 用い、他方、光学装置のアライメントマークを、上記光 素子の発光または受光中心とするか、もしくは光素子上 に別に形成したアライメントマークを設け、上記フォト マスクのアライメントマークと、上記光学装置のアライ メントマークとを位置合わせすることにより、上記フォ トマスクと上記光学装置の位置を合わせ、上記マイクロ レンズを形成する基板上に、上記マイクロレンズ材料と 屈折率の等しい感光性材料膜を形成する工程と、上記感 現像することにより、中心にアライメントマークを有す るマイクロレンズパタンを転写したレンズマーカ用膜を 形成する工程と、上記レンズマーカ用膜のマイクロレン ズパタン上に、レンズ用液状樹脂を射出して、液状のマ イクロレンズを形成する工程と、UV光を照射して、上 記液状のマイクロレンズを硬化させてマイクロレンズを 形成する工程とを少なくとも含むマイクロレンズ形成方 法とするものである。

【0011】このような請求項1に記載の工程でマイク ロレンズを作製すると、光学装置(光素子あるいは光部 10 品等)とマイクロレンズとの光軸合わせが、従来に比べ て格段に容易となり、位置精度の高いマイクロレンズを 低コストで形成することが可能となる。

【0012】また、請求項2に記載のように、光信号光 が透過する基板を介して光信号が光素子に入出力する光 学装置の上記基板表面にマイクロレンズを形成する方法 であって、上記マイクロレンズを形成する部分を規定す るマイクロレンズパタンと、該パタンの内部に形成され たアライメントマークパタンとを有するフォトマスクを 用い、他方、光学装置のアライメントマークを、上記光 20 素子の発光または受光中心とするか、もしくは光素子上 に別に形成したアライメントマークを設け、上記フォト マスクのアライメントマークと、上記光学装置のアライ メントマークとを位置合わせすることにより、上記フォ トマスクと上記光学装置の位置を合わせ、上記マイクロ レンズを形成する基板上に、感光性材料膜を形成する工 程と、上記基板上に形成した感光性材料膜に、上記フォ トマスクを用いて、上記マイクロレンズを形成する部分 を規定するマイクロレンズパタンと、該パタンの内部に 形成したアライメントマークパタンとを転写する工程 と、上記感光性材料膜を過現像して、該感光性材料膜に 転写された上記アライメントマークを消去し、上記マイ クロレンズを形成する部分を残したレンズマーカ用膜を 形成する工程と、上記マイクロレンズを形成する部分 に、レンズ用液状樹脂を射出し、液状のマイクロレンズ を形成する工程と、UV光を照射して、上記液状のマイ クロレンズを硬化させてマイクロレンズを形成する工程 とを少なくとも含むマイクロレンズ形成方法とするもの である。

【0013】このように請求項2に記載の過現像を行 い、アライメントマークを消去し、マイクロレンズを形 成する部分を残す工程を用いることにより、レンズマー カとマイクロレンズの樹脂材料の屈折率を整合させる必 要がなくなり、マイクロレンズ用樹脂材料の選択の幅が 広くなる効果がある。

【0014】また、請求項3に記載のように、請求項2 において、上記感光性材料膜を過現像して、アライメン トマークを消去し、マイクロレンズを形成する部分を残 したレンズマーカ用膜は、上記基板表面上の上記マイク

を形成する部分の外側の領域に形成され、かつ上記光信 号光の波長に対して吸収性を有する材料よりなるマイク ロレンズ形成方法とするものである。

【0015】上記請求項3のようなマイクロレンズ形成 方法とすることにより、レンズマーカ用樹脂材料は、使 用波長に対して透明である必要がなく、光素子がアレイ 状に配置されている場合には、あえて着色した材料を用 いることにより、隣接チャネル間の光学的クロストーク を低減し得る効果がある。

#### [0016]

【発明の実施の形態】〈実施の形態1〉図1に本発明の 第1の実施の形態を示す。図1において、マイクロレン ズの製造方法は、光信号光が透過する基板12を介して ダイボンドされた光素子3に入出力する光学装置におけ る上記基板12の表面にマイクロレンズを形成する方法 である。

【0017】マイクロレンズを形成する部分を規定する マイクロレンズパタンと、該パタンの内部に形成したア ライメントマークパタン(中心アライメント用微小マー ク) 5を有するフォトマスク1〔図1(a)〕を用い、 上記光素子3上のアライメントマーク(光素子の発光ま たは受光中心)4と、上記フォトマスク1のアライメン トマーク5とを位置合わせすることにより、フォトマス ク1と光学装置3の位置を合わせて、光学装置3とマイ クロレンズとの光軸合わせを行う〔図1(b)〕。マイ クロレンズを形成する基板12上に、マイクロレンズ材 料と屈折率の等しい感光性材料膜2を形成し、上記感光 性材料膜2を、フォトマスク1を用い、露光した後、現 像することにより、中心に凹型アライメントマーク8を 30 有する凸型レンズマーカ用膜(マイクロレンズパタンを 転写したレンズマーカ用膜) 9を形成する〔図1

(c)〕。レンズマーカ用膜9のマイクロレンズパタン 上に、インクジェットヘッド13〔図1(d)〕を用 い、レンズ用液状樹脂14を射出/吐出して〔図1

(e)]、液状のマイクロレンズ16を形成し、UV光 照射15して、該液状のマイクロレンズ16を硬化させ て〔図1(f)〕、マイクロレンズ17〔図1(g)〕 を形成する。

【0018】マイクロレンズ17を形成する部分を規定 40 するマイクロレンズパタン(以後、レンズマーカ用膜と 呼ぶ)は、露光した箇所が硬化するネガ型の感光性材料 膜2を用いているので、その中心部に十字、または円盤 状等の形をしたアライメントマークが形成される。この アライメントマークは、遮光部分であるため、凸型レン ズマーカ用膜9の中心部には、アライメントマークパタ ンに対応した凹み(窪み)のある凹型アライメントマー ク8が形成される。しかしながら、この凹型アライメン トマーク8の凹みの部分は、続いて行われるレンズ用液 状樹脂 1 4 の液滴の射出/吐出の工程で塞がれ、凸型レ ロレンズを形成する部分に近接して、該マイクロレンズ 50 ンズマーカ用膜9と全く同じ固相となり、均質なマイク

る。

ロレンズを形成することができる。ここで、凸型レンズマーカ用膜およびマイクロレンズ用樹脂材料の屈折率を整合させておけば、レンズマーカ用膜9と凹型アライメントマーク8間の凹みは光学的には界面とはならず、均質で透明なマイクロレンズを得ることができた。

【0019】 (実施の形態2) 図2に本発明の第2の実 施の形態を示す。図2において、露光した部分が除去さ れるポジ型の感光性樹脂を用いて、レンズマーカを形成 するものである。ポジ型の感光性樹脂を用いることで、 上記実施の形態1とは反対に、マイクロレンズ部分が凹 10 んだ (窪んだ) 形状のレンズマーカ用膜(凹型レンズマ ーカ用膜) 10が形成される。マイクロレンズを形成す る部分を規定するマイクロレンズパタンと、該パタンの 内部に形成したアライメントマークパタン5とを有する フォトマスク1〔図2(a)〕を用い、光素子3のアラ イメントマークパタンを光素子(光学装置)3の発光ま たは受光中心とし、フォトマスク1のアライメントマー クパタン5とを位置合わせすることにより、フォトマス ク1と光学装置3の位置を合わせ、ポジ型の感光性材料 膜2′を形成した基板12を、上記マイクロレンズパタ ンを有するフォトマスク1を用いて露光6する〔図2 (b) ]。現像して、内部に、凸型アライメントマーク

(c)]。以下、インクジェットへット13 [図2 (d)]を用いて、レンズ用液状樹脂14を射出 [図2 (e)]し、液状マイクロレンズ16形成し、UV光照射15 [図2(f)]して、マイクロレンズ17を形成する工程 [図2(g)]は、上記実施の形態1とほぼ同様である。

7を有する凹型レンズマーカ用膜10を形成する〔図2

【0020】本実施の形態2においも、上述の実施の形 30 態1と同様に光素子の発光/受光中心とマイクロレンズ の位置を合わせるために、マイクロレンズの中心部にアライメントマークが形成されている。このアライメントマークは現像処理工程において、エッチングされずに残るため、図2に示すように微小な凸型アライメントマーク7となる。しかしながら、続いて行われる液体樹脂の射出工程によって、微小凸部は覆われるので、上記実施の形態1と同様に、レンズマーカ用樹脂材料とマイクロレンズ用樹脂材料との屈折率を整合させることにより、この微小凸部は光学的に透明となる。なお、凹型レンズ 40 マーカ用膜におては、レンズマーカ用樹脂材料として、撥水性の高い材料を用いることが好ましい。

【0021】(実施の形態3)本実施の形態3では、図3に示すごとく、図2の場合において凹型レンズマーカ用膜10の内部に形成された凸型アライメントマーク7を除去し、凹型レンズマーカ用膜とマイクロレンズの樹脂材料の屈折率を整合させる必要がなく、マイクロレンズ用樹脂材料の選択幅を広くすることができるマイクロレンズの形成方法について述べる。

【0022】図3(c)に示すように、ポジ型の感光性 50 用膜9(図1)とでは、凸型レンズマーカ用膜9の方

材料膜2′を形成した基板12を用い、フォトマスク1のアライメントマークパタン5と光素子3上のアライメントマークパタン(発光/受光中心)4とを位置合わせすることにより、フォトマスク1と光素子(光学装置)3の位置合わせをした後、露光6して現像する工程において過現像を行い、ポジ型の感光性材料膜2′に転写された凸型アライメントマーク7を除去し、マイクロレンズで形成部分の外周側の縁を規定する凹型レンズマーカ用膜10′を形成する。次に、マイクロレンズを形成する部分である凹型レンズマーカ用膜10′上に、レンズ用液状樹脂14を射出して〔図3(e)〕、液状のマイクロレンズ16を形成し、UV光照射15して、硬化させ

〔図3 (f)〕、マイクロレンズ17をを形成する工程

〔図3(g)〕は、上記実施の形態1~2と同様であ

【0023】このようなマイクロレンズ形成方法とする ことにより、レンズマーカとマイクロレンズの樹脂材料 の屈折率を整合する必要がなくなり、マイクロレンズ用 樹脂材料の選択の幅を広くすることができる。また、凹 型レンズマーカ用膜の樹脂材料として、使用波長に対し て透明である必要がなく、光素子がアレイ状に配置され ている場合などにおいて、あえて着色した材料を用いる ことにより、隣接チャネル間の光学的クロストークを低 減する効果も期待できる。しかし、一般的にポジ型(光 分解型)の感光性材料は種類が少ないため、樹脂の信頼 性などの実績が優先する場合には、ネガ型感光性樹脂を 用いる方が得策である。なお、上記実施の形態1~3で 使用したレンズマーカ作製用マスクパタンの一例を図5 に示した。図5ではアライメントマークとして微小円盤 状のものを示したが、十字形状等であってもかまわな **V** \₀

【0024】(実施の形態4)図4に示すように、本実施の形態4においては、リング状のレンズマーカパターン19を有するフォトマスク1 [図4(a)]を用いて、リング状レンズマーカ用膜11を形成することにより、マイクロレンズを作製する場合について説明する。ポジ型の感光性樹脂を用いてパターニングする点は、上記実施の形態2と同じであるが、マイクロレンズ用の樹脂材料を滴下した際に、リング状レンズマーカ用膜11の外側の縁でマイクロレンズの外形が決定される点が異なる。

【0025】凹型レンズマーカ用膜10(図2)は、マイクロレンズ用の樹脂を滴下した際に、その広がりを止めるために、撥水性材料を用いたり、レンズマーカの厚みを厚くしたりする、などの工夫が必要であった。これらは、作製プロセスを制限し、困難化させる要因であり、また、縁部のわずかな欠け、荒れなどによって、樹脂がレンズマーカ用膜上に広がってしまうことがある。凹型レンズマーカ用膜10(図2)と凸型レンズマーカ用膜0(図1)と凸型レンズマーカ

が、再現性良くマイクロレンズを形成することができ る。すなわち、本実施の形態4に示すリング状レンズマ ーカ用膜11は、凸型レンズマーカ用膜9の持つマイク ロレンズ作製の再現性の良さと、凹型レンズマーカ用膜 10が持つマイクロレンズ用樹脂材料の選択肢の広さの 両方の良い点を併せ持つものである。

【0026】上記実施の形態3と同様に、リング状レン ズマーカ用膜11においても、マイクロレンズ中心部の アライメントマークは、過現像によって除去することが できる。その際に、リング部分も同様に過現像されるた め、リング幅の設計には注意する必要がある。なお、上 記実施の形態においては、液状樹脂を射出する方式に、 インクジェット方式を取り上げてきたが、これは、イン クジェット方式に限定するものではなく、微小量の液滴 を制御性良く滴下することができる方式であれば適用す ることができ、例えば、ディスペンサ方式を用いること も可能である。また、上記実施の形態においては、光素 子としてシングルチャネルのものを取り上げてきたが、 これは単チャネルに限定するものではない。一次元ない し二次元状に配列された光素子アレイにおいても、全く 20 同様に、上記本発明のマイクロレンズ形成方法を適用す ることができる。

# [0027]

【発明の効果】本発明の微小量の液滴が基板上で球形状 となる性質を利用したマイクロレンズ形成方法によれ ば、マイクロレンズの直径とアレイ配列の正確性・再現 性を高めるために用いられるレンズマーカのマスクパタ ーンにおいて、マイクロレンズの中心部に微小なアライ メントパターンを形成し、これと光素子(光学装置)の 発光/受光中心とをアライメントすることによって、そ 30 れらの光軸を容易に合わせることが可能となる。光素子 とマイクロレンズとの光軸を合わせるために用いられ、 その形成位置精度を高めるために使用されるレンズマー カとして、特別なアライメントマークを形成する必要が なく、光素子をフリップチップなどの高級な実装方法を 用いて搭載する必要もなく、また、チップ表面に新たに アライメントマークを設ける必要もない。さらに、チッ プ外形が小さく、マイクロレンズの投影サイズ内に収ま ってしまうために、アライメントマークを形成すること のできない場合においても、光素子と光軸が合ったマイ 40 21…マイクロレンズ クロレンズを低コストで作製することができる。また、 マイクロレンズと光素子のアライメントに用いられるレ ンズマーカが、光透過領域内にあるにもかかわらず、光 学的もしくは物理的に除去することができ、不要な境界 面の増加を防ぐことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

10

【図1】本発明の実施の形態1で例示したマイクロレン ズ形成方法を説明する図。

【図2】本発明の実施の形態2で例示したマイクロレン ズ形成方法を説明する図。

【図3】本発明の実施の形態3で例示したマイクロレン ズ形成方法を説明する図。

【図4】本発明の実施の形態4で例示したマイクロレン ズ形成方法を説明する図。

【図5】本発明の実施の形態1~3で使用したレンズマ ーカ作製用マスクパタンの一例を示す平面図。

【図6】従来の微小量の液滴の表面張力を利用したマイ クロレンズの製造方法を示す説明図。

【図7】従来のレンズマーカを用いたマイクロレンズの 製造方法を示す説明図。

## 【符号の説明】

1…フォトマスク(マイクロレンズパタン)

2…感光性材料膜

2′ …感光性材料膜

3 …光学装置(光素子)

4…光素子上のアライメントマーク(例えば発光/受光 中心)

5…マイクロレンズのアライメントマーク(例えば中心 アライメント用微小マーク)

6…露光

7…凸型アライメントマーク

8…凹型アライメントマーク

9…凸型レンズマーカ用膜

10…凹型レンズマーカ用膜

10′…凹型レンズマーカ用膜 11…リング状レンズマーカ用膜

1 2 … 基板

13…インクジェットヘッド

14…レンズ用液状樹脂

15…UV光照射

16…液状マイクロレンズ

17…マイクロレンズ

18…レンズマーカ作製用マスクパタン

19…リング状レンズマーカパタン

20…ステージ

22…フォトマスク(マイクロレンズパタン)

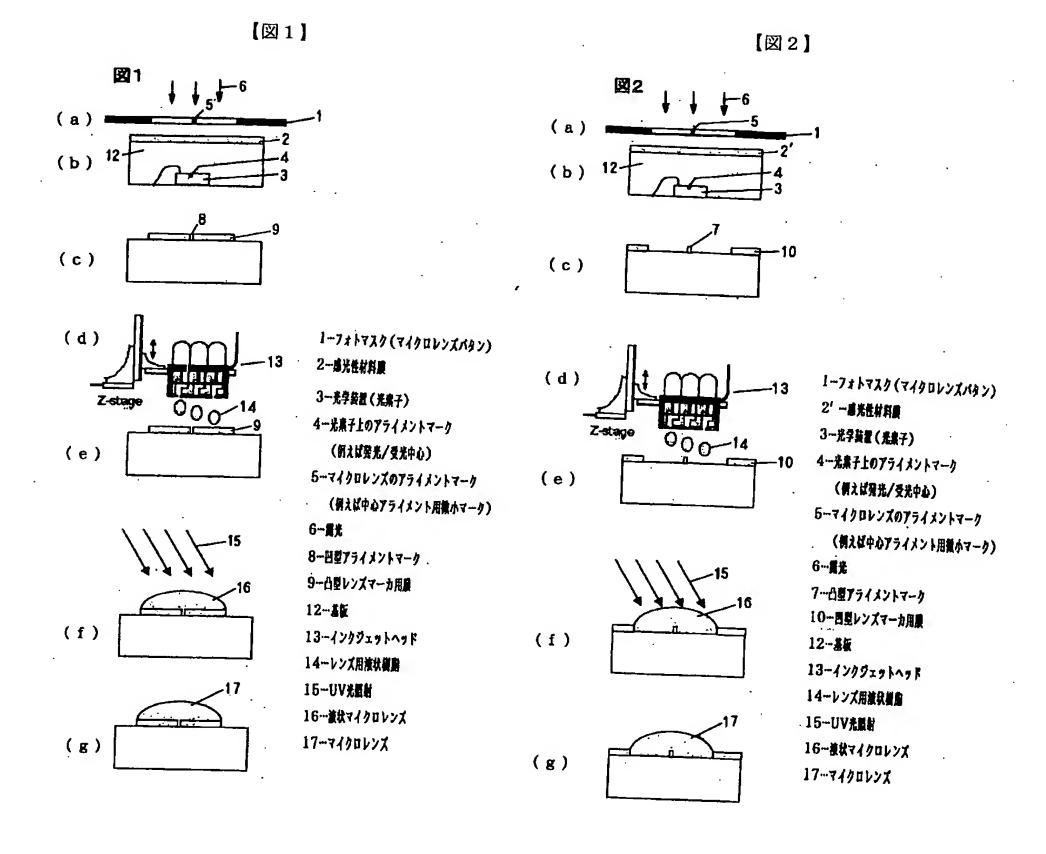
23…感光性樹脂

24…円盤状の透明樹脂(凸型レンズマーカ用膜)

25…液状UV光硬化樹脂

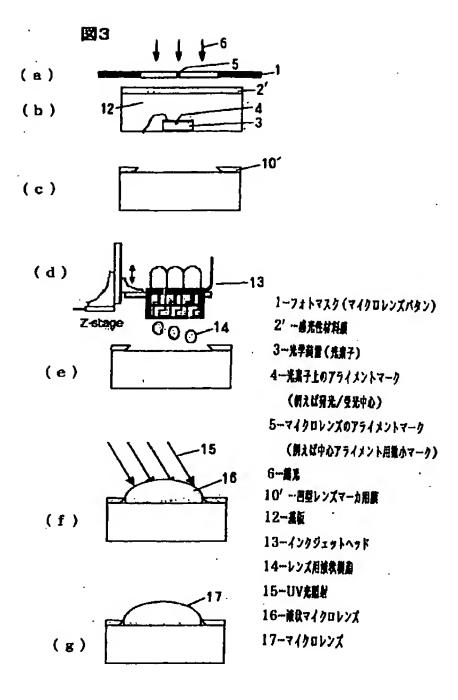
26…マイクロレンズ

2

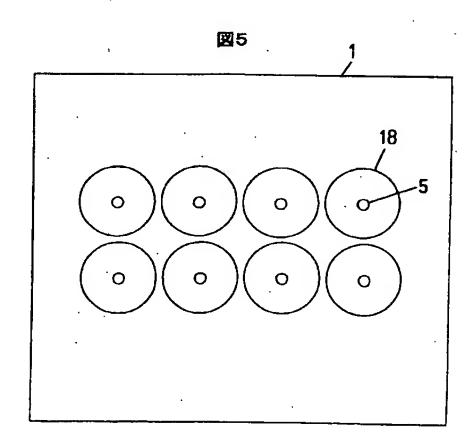


7

【図3】



【図5】



1…フォトマスク (マイクロレンズパタン) 5…マイクロレンズのアライメントマーク 18…レンズマーカ作製用マスクパタン

【図4】

